

©1994 г.

## ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ МЕЖДУ ЗОНОЙ ПРОВОДИМОСТИ И ВЕРХНЕЙ ЗОНОЙ ХАББАРДА

*Е.М.Гершензон, Ф.М.Исмагилова, Л.Б.Литвак-Горская*

Московский педагогический государственный университет, 119882, Москва,  
Россия

(Получена 20 октября 1993 г. Принята к печати 10 ноября 1993 г.)

Исследована зависимость энергетической щели  $\epsilon$  между дном зоны проводимости и верхней зоной Хаббарда в широком диапазоне легирования:  $0.07 \leq N^{1/3}a \leq 0.25$  ( $N$  — концентрация примеси,  $a$  — радиус локализации носителя заряда на примеси). Показано, что при  $N^{1/3}a \leq 0.12$  экспериментальные значения  $\epsilon(N)$  совпадают с рассчитанными по теории Х.Нишимуры.

1. Цель работы — исследование зависимости энергетической щели между зоной проводимости и верхней зоной Хаббарда (ВЗХ) от концентрации примесей в широком диапазоне легирования.

Известно [1], что в легированных и слабо компенсированных полупроводниках, когда средний радиус сферы, занимаемой примесным центром  $r = (3/4\pi N)^{1/3}$ , варьируется в пределах  $r \simeq (2.5 \div 6)a$  ( $N^{1/3}a \simeq 0.12 \div 0.25$ ), наблюдается проводимость по зоне делокализованных примесных состояний —  $\epsilon_2$ -зоне. Здесь  $N$  — концентрация основной примеси,  $a$  — радиус локализации носителя заряда на примесном центре. Энергетическая щель между  $\epsilon_3$ -зоной и зоной основных примесных состояний ( $\epsilon_2$ -зоной), определяемая как энергия  $\epsilon_2$ , уменьшается с увеличением  $N$ ,  $\epsilon_2 = 0$  соответствует переходу металлизатор (переходу Мотта),  $N^{1/3}a \simeq 0.25$  [2]. Принято считать, что  $\epsilon_2$ -зона — это верхняя зона Хаббарда, т.е. зона, образованная вследствие перекрытия  $D^-$ -состояний доноров ( $A^+$  — состояний акцепторов). Схема примесных зон представлена на рис. 1 (вставка) [2]. Основная информация об  $\epsilon_2$ -зоне и зависимости  $\epsilon_2(N)$  найдена из гальваномагнитных измерений, в частности, из температурной зависимости электропроводности  $\sigma$ , для которой, начиная с  $N^{1/3}a \geq 0.12$ , характерно появление участка экспоненциальной зависимости  $\sigma(T^{-1})$  с энергией активации  $\epsilon_2$ . Заметим, что полученное при этом максимальное значение энергии составляет  $\epsilon_2 \simeq 0.6$  Ry, в то время как энергия электрона

в  $D^-$ -состоянии  $J \simeq 0.05$  Ry, а делокализация  $D^-$ -состояний наблюдается при существенно меньших концентрациях примесей ( $N^{1/3}a \geq 0.07$ ) [3]. Это свидетельствует о существовании проводимости по  $\epsilon_2$ -зоне и при  $N^{1/3}a \leq 0.12$ , не проявляющейся, однако, в гальваномагнитных измерениях из-за своей малости по сравнению с проводимостью по  $\epsilon_3$ -зоне и проводимостью за счет свободных носителей заряда.

2. Возможность исследования ВЗХ при относительно слабом легировании возникла с началом изучения фотопроводимости ( $\Phi\text{П}$ ) в очень слабо компенсированном Si (степень компенсации  $K \leq 10^{-4}$ ) при низком уровне примесного возбуждения, когда существенный вклад в полную проводимость дают фотоэлектроны  $D^-$ -зоны [3,4]. Этот факт приводит к тому, что концентрация свободных электронов определяется не только интенсивностью примесного возбуждения, но и термической активацией из  $D^-$ -зоны, вследствие чего в диапазоне температур  $T \simeq 7 \div 14$  К  $\Phi\text{П}$  за счет свободных электронов  $\sigma_c$  имеет температурную зависимость вида [4]

$$\ln(\sigma_c) \sim (-\epsilon/kT),$$

где  $\epsilon$  — энергетический зазор между зоной проводимости и нижним краем делокализованных состояний в  $D^-$ -зоне. Таким образом, исследование  $\sigma_c(T)$  позволяет найти зависимость  $\epsilon$  от концентрации легирующей примеси в том диапазоне концентраций, когда существенная проводимость за счет свободных носителей заряда  $\sigma_c$  (для  $p\text{-Si(B)}$ ) — это  $N \leq 1.2 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$ ) [5].

3. Нами исследована низкотемпературная фотопроводимость  $p\text{-Si(B)}$  с  $N \simeq 4 \cdot 10^{16} \div 2 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$  и  $10^{-2} > K > 10^{-4}$  при малом уровне примесного возбуждения  $W_{ph} = 0.25$  с $^{-1}$ . Выполненное нами ранее [4,5] исследование  $\sigma_c(T)$  позволяет найти только величину  $\epsilon(N)$  и не дает иной информации о ВЗХ. На рис. 1 представлены экспериментальные значения  $\epsilon$  и рассчитанная по [6] теоретическая зависимость  $\epsilon(N)$ , которые хорошо совпадают. Из рисунка видно монотонное возрастание  $\epsilon$  по мере увеличения  $N$ .

Работа [6], как нам известно, является единственной попыткой теоретического рассмотрения ВЗХ в полупроводниках, выполненного для  $D^-$ -состояний в приближении сильной связи, но без учета флюктуационного потенциала заряженных примесей, поскольку предполагалось, что  $K = 0$ . Одним из результатов [6] является расчет ширины энерге-

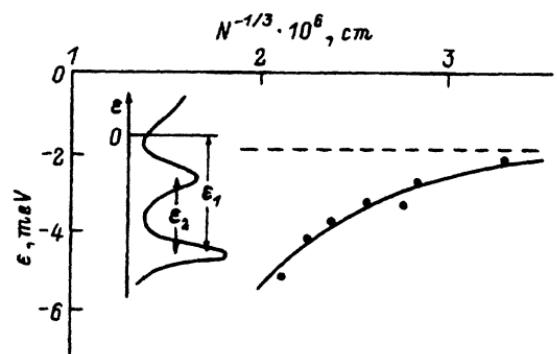


Рис. 1. Зависимость ширины энергетической щели между зоной проводимости и дном  $D^-$ -зоны от концентрации примесей в Si(B).

На вставке — схема примесных зон в полупроводниках по [2].

тической щели  $\varepsilon$  между зоной проводимости и дном  $D^-$ -зоны в зависимости от параметров материала и концентрации примесей:

$$\varepsilon \simeq -J - 4\pi a^3 N V_0 \left[ 1 + 16(4 + \alpha)/(2 + \alpha)^3 \right], \quad (1)$$

где  $J$  — разность энергий основных состояний нейтрального донора и отрицательно заряженного донора,  $V_0 = e^2/(2\pi a)$  — кулоновский потенциал,  $\alpha \simeq 0.235$  — коэффициент, численно равный отношению радиусов основного и  $D^-$ -состояния донора. Для  $p\text{-Si(B)}$   $J = 2$  мэВ,  $a = 2.3 \cdot 10^{-7}$  см.

Совпадение расчетных и экспериментальных значений  $\varepsilon$  нам представляется не случайным для столь слабо компенсированного материала при  $N^{1/3}a < 0.12$ , поскольку в нем флуктуационный потенциал заряженных примесей [7]

$$W = 0.26e^2 \pi^{-1} N^{1/3} K^{1/4}$$

мал по сравнению с  $\varepsilon$ . Так, в образце с  $N \leq 2 \cdot 10^{17}$  см<sup>-3</sup> и  $K \simeq 10^{-4}$   $W \leq 0.2$  мэВ, т.е. более чем в 10 раз меньше  $\varepsilon$ . В остальных, менее легированных образцах, величина  $W/\varepsilon$  еще меньше.

4. Рассмотрим экспериментальные значения  $\varepsilon$  во всем диапазоне концентраций примесей, где существует проводимость по ВЗХ. Для этого, помимо использованных нами результатов измерений ФП в Si [8], привлечем данные по исследованию температурной зависимости в  $n\text{-Ge(Sb)}$  [9,10], где компенсация примесей значительно выше ( $K \leq 0.15$ ). На рис. 2 представлены теоретические и экспериментальные значения  $\varepsilon(N)$  в относительных единицах:  $\varepsilon$  — в долях Ридберга, концентрация примесей — в виде безразмерного параметра  $N^{1/3}a$ . В случае  $\varepsilon_2$ -проводимости  $\varepsilon = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ , где  $\varepsilon_1$  — энергия активации проводимости по свободной зоне. Значения  $\varepsilon$ , найденные по температурной зависимости проводимости  $\sigma(T)$ , в области  $\varepsilon_2$ -проводимости объединены

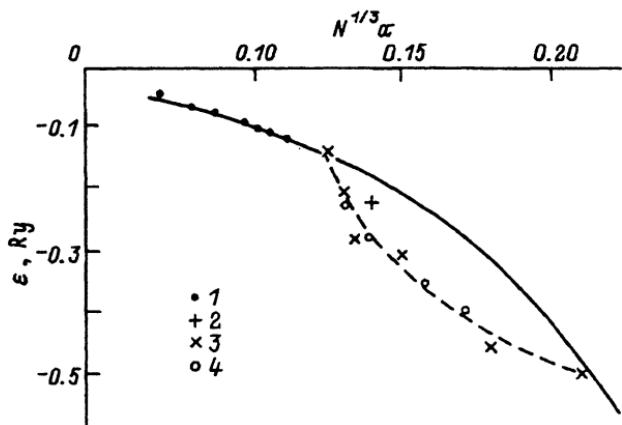


Рис. 2. Зависимость энергетической щели между зоной проводимости и дном  $D^-$ -зоны от безразмерного параметра  $N^{1/3}a$  для различных полупроводников: 1 — результаты наших измерений в  $p\text{-Si(B)}$ , 2 — данные [8] для  $p\text{-Si(B)}$ , 3,4 — данные [9,10] для  $n\text{-Ge(B)}$ .

штриховой кривой. Из рисунка видно, что экспериментальная зависимость  $\varepsilon(N)$  для них не зависит от компенсации, т.е. не отвечает теории, за исключением самых малых концентраций, когда  $N^{1/3}a \leqslant 0.125$ .

5. Настоящая работа не является попыткой реанимации теории [6], часть положений которой нам не вполне понятна. Возможно, работа [6] не получила дальнейшего развития в связи с тем, что не было совпадения расчета с экспериментом, несмотря на предпринятое автором не вполне обоснованную корректировку рассчитанных по (1) значений  $\varepsilon$ . Из рис. 2 видно, что совпадение теории с экспериментом должно иметь место при существенно меньших концентрациях примесей.

### Список литературы

- [1] H. Frizshe. Phys. Rev., **99**, 406 (1955).
- [2] Н. Мотт, Е. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Т. 1. М.: Мир (1982).
- [3] Л.А. Ворожцова, Е.М. Гершензон, Ю.А. Гурвич, Ф.М. Исмагилова, А.П. Мельников, Р.И. Рабинович. Письма в ЖЭТФ, **43**, 480 (1986).
- [4] Л.А. Ворожцова, Е.М. Гершензон, Ю.А. Гурвич, Ф.М. Исмагилова, Л.Б. Литвак-Горская, А.П. Мельников. ЖЭТФ, **93**, 1419 (1987).
- [5] Е.М. Гершензон, Ф.М. Исмагилова, Л.Б. Литвак-Горская, А.П. Мельников. ЖЭТФ, **100**, 1029 (1991).
- [6] H. Nishimura. Phys. Rev. A, **138**, 815 (1965).
- [7] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства полупроводников. М.: Наука (1979).
- [8] Ф.М. Исмагилова, Л.Б. Литвак-Горская, Г.Я. Луговая, И.Е. Трофимов. ФТП, **25**, 255 (1991).
- [9] Е.М. Гершензон, Л.Б. Литвак-Горская, Г.Я. Луговая. ФТП, **15**, 1284 (1981).
- [10] E. Davis, W. Compton. Phys. Rev. A, **140**, 2183 (1965).

Редактор Л.В. Шаронова